# クラスター成長領域の時空間局所閉じ込めに成功 - 機能性クラスタープロセス技術の新展開 -

Spatiotemporal confinement of cluster growth

- Progress in nanostructural cluster process technologies -

エネルギー部 クラスター物性ラボ 韓 民<sup>\*1</sup>、木山 学、福田 昭<sup>\*2</sup>、岩田 康嗣<sup>\*3</sup> STA フェロー、南京大学固体微構造研<sup>\*1</sup>、量子放射部<sup>\*2</sup> 東京大学大学院工学系研究科 武藤 麻紀子、澤田 嗣郎 日立造船株式会社技術研究所 滝谷 俊夫、小村 明夫 Cluster Science Lab, Energy Technology Division Min Han<sup>\*1</sup>, Satoru Kiyama, Akira Fukuda<sup>\*2</sup>, Yasushi Iwata<sup>\*3</sup> Solid State Microstructures Lab, Nanjing Univ<sup>\*1</sup>, Quantum Radiation Division<sup>\*2</sup> Graduate School of Engineering, Univ. of Tokyo, Makiko Muto, Tsuguo Sawada Hitachi Zosen Corp. Technical Research Institute, Toshio Takiya, Akio Komura

e-maill: y.iwata@etl.go.jp\*3

We have developed a new cluster source, which enables one to get a cluster beam with a well-defined cluster size, an electronic state and a crystallographic structure. A cluster beam with a well-defined internal freedoms has practically advantages for progress in nanostructural cluster process technologies. The internal freedoms of a cluster are determined by the thermodynamic conditions of cluster growth. In the developed new cluster source, a laser-induced shock wave in helium ambient spatiotemporally confines a cluster growth area of vapor mixed with a helium gas, and the thermodynamic conditions are uniformly confirmed. We observed a photoluminescence from a vapor pulse, and it becomes clear that the mixed gas layer is successfully confined in a space of 0.4mm and in time longer than  $15\mu$ s.

# 1.はじめに

電総研では気相中のクラスタービーム生成におい て、初めてショック波によってクラスター成長を 0.4mmの領域に15µs以上に渡って閉じ込めることに 成功した。この閉じ込めによりクラスターのサイズ、 電子状態、結晶構造など内部状態が揃った機能性ク ラスタービームの生成を可能にし、クラスターを利 用した気相プロセス技術においてナノレベル以下の 微細構造制御に実用技術開発の道が開けた。

クラスターはサイズ数ナノメーターの熱的に安定 な結晶構造を持ち、化学反応性や光感度に優れた性 質を示す。電総研で開発を進めるクラスターのサイ ズ、電子状態、結晶構造など内部状態を制御した機能 性クラスタービームは、薄膜生製プロセスにおいて 高精度のナノレベル微細構造制御を可能にし、微細 粒子が関与するプロセスにおける様々な問題を解決 する。太陽電池の薄膜生製プロセスでは、微細粒子制 御が廉価生産性の向上を目指す上で重要な鍵を握る。 また急速な展開が進む情報インフラテクノロジーに



図 (a) 基板上のクラスターに認起する電気双極子 (b) 電気双極子間の相互作用によるクラスター の長距離秩序形成 おける半導体記録媒体(ROM)、磁気記録媒体、液晶、 発光・受光デバイス素子など、薄膜生製プロセス技術 開発では、ナノレベル以下の精度で微細構造制御が 要求される。機能性クラスタープロセス技術では、こ うしたプロセスの高度な要求に的確に答えるべく開 発をすすめており、幅広い分野に亙りその利用が期 待できる。

薄膜生製プロセスにクラスターを利用する場合、 基板上でクラスターが長距離秩序を形成することに より、微細構造制御が可能になる。クラスターが基板 表面に吸着すると、基板との相互作用によってクラ スターと基板との間に電荷移行が生じ、クラスター には大きな電気双極子が誘起される図1(a)。電気双 極子の大きさはクラスター半径の3乗即ちクラス ターの構成原子数に比例して大きくなる。サイズの 揃ったクラスターが基板上に配列すると、大きさの 揃った双極子間相互作用は等周期的になり、長距離 秩序が生まれる図1(b)。これまでに水溶液中におけ るクラスター成長で長距離秩序が一部観測されてい る。しかし反応制御性に優れ、反応速度の点で勝る気 相反応において、クラスターの長距離秩序による微 細構造制御を行うことが薄膜生製プロセスの実用技 術開発を進める上で重要となる。従って気相中にお けるクラスターのサイズや電子状態、結晶構造など 内部状態を制御した機能性クラスタービームの開発 意義は大きい。

### 2.機能性クラスタービーム源の開発

### (1)機能性クラスターの生成原理

クラスターの素材には希ガスや酸素、窒素といっ た常温で気体状態にある物質から金属、半導体、誘電 体などの固体に至るありとあらゆる種類があり、全 てビームとして取り出すことができる。気体状態に ある素材のクラスターでは、気体を直接ノズルから 噴出することによってクラスター化する。これをイ オンビームとして用いることで、プロセスにおける 基板の清浄、酸化膜、窒化膜の形成等に威力を発揮す る。一方、固体を素材にしたクラスターは、クラス ターの優れた物性を薄膜生製に生かすことができる ことから、ナノレベル以下の高精度に制御されたク ラスター成膜技術として期待される。薄膜生製に利 用されるクラスタービームの生成には、素材となる 固体をレーザーにより蒸発させる方法と、直接加熱 やイオンスパタリングにより蒸発する方法などが採 られる。前者の方法は、遷移金属などの高融点材料を も含む適用素材の種類の広さと、化合物を素材にし たクラスターの生成が容易であるなどの優れた特徴 を持つ。

レーザー蒸発型のクラスター生成では、クラス ター生成セルをヘリウムガスで充たし、その中に セットした試料にレーザーパルスを照射して数千度 の温度で試料を瞬時に蒸発させる。蒸発した原子は 周囲のヘリウムガスによって冷やされ、凝集して 10nm以下のサイズのクラスターが生成される。ここ でクラスターサイズに拡がりが生じる原因はクラス ター成長の熱力学的条件である気相の温度と密度が正 確に規定できない事に因り、クラスターサイズ分布の 拡がり幅△Nは平均サイズNに対して従来△N/N~0.5が 一般的な値であった。これに対してクラスターの生 成時間を短く規定することにより、サイズ分布の拡 がりを △N/N~0.01 程度にまで小さくすることが可能 であることが判明した図2。これはクラスター成長 を時間的空間的に局所領域に限定することにより、 気相の温度と密度が正確に規定されるためである。 クラスター成長における熱力学的条件が揃うことに よって、クラスターサイズを始めクラスターの電子 状態、結晶構造が一様となり、ナノ構造制御を可能に する機能性クラスタービームが誕生する。

#### (2)機能性クラスタービーム源

クラスター成長を時間的空間的局所領域に規定し、 内部状態の揃ったクラスタービームを生成する機能



# 図 2 クラスターサイズの拡がりと閉じ込め時 間との関係

性クラスター源を制作した図3。クラスター成長領 域の閉じ込めには気相中のレーザー照射の際に形成 されるショック波を利用する。クラスター生成セル 内に固体試料を設置し、試料から20mm離れて対向す るセルの壁の中心に開いた0.2mm 径の穴からレー



図 3 機能性クラスタービーム源



レーザ照射時の試料表面温度変化 図 4



**Confined cluster growth** 

ザーをセル内に導入する。50mJ/pulseの強度で試料を 照射すると、試料の固体表面の温度は瞬時に6500Kに 達し、照射終了と同時に温度は急速に下がる図4。こ の間に5×10<sup>18</sup>/cm<sup>3</sup>の密度で原子が蒸発し、蒸気波束と なって試料表面から噴出する。冷却用ヘリウムガス は球状の試料ホルダーの周囲から層流として導入し、 クラスター生成セル内を1000Paの圧力で充たす。蒸 気波束はヘリウム気相中を3000m/sの速度でヘリウム ガスを押し退けながら進行し、ヘリウム気相中には ショック波が生じる。ショック波は蒸気波束の進行 速度より速い4000m/sで気相中を伝搬し、セルの壁で 反射して折り返し、蒸気波束と再び衝突して波束の 進行を停止させる図5。蒸気相とヘリウム気相とが 接触する境界領域では、蒸気とヘリウムの混合ガス 相が形成され、クラスター成長は唯一この境界領域 でのみ起こる。ショック波が反射する壁(反射板)の 形状は3次元的に伝搬するショック波を1点に集中 させて、境界領域の混合ガス相を局所的に閉じこめ るように設計されている。反射したショック波の波 面が境界領域に達すると、混合ガスの気相密度は周 囲に比べて1桁高くなる。この状態がクラスター成 長に必要な一定時間維持され、混合ガス相は時間的 空間的に局所領域に閉じ込められることになる。こ の間、混合ガス相の気相密度と温度は一様になり、ク ラスター成長の熱力学的条件が一律に規定され、内部 状態の揃ったクラスタービーム生成を可能にする。 (3) クラスター成長領域の局所閉じ込め観測

機能性クラスタービーム源の生成セルの側面に覗 き窓を設け、クラスター成長領域の閉じ込め過程を 高速度カメラ(Hamamatsu Phot. C5987)を利用して直接 観測した。クラスター生成セルにシリコン試料を設置 し、ヘリウムガスを1300Paの圧力で導入してNd:YAG レーザー2倍高調波パルスビーム(532nm, 10ns, 50mJ) の照射を行った。レーザー照射後0.2µs~10µsの間、高 速度カメラの露光を行った結果、試料表面から 6mm の位置に輝度の高い発光像が観測された図6(a)。こ れはレーザー照射によって試料表面から噴出したシ リコン蒸気がヘリウム気相のショック波に押されて 圧縮され、高密度の波束となって発光したものであ る。ヘリウムガスの圧力を 1/10(P<sub>He</sub>=130Pa)にした場 合には、レーザー照射後40µsを経過しても蒸気波束 の進行は停止せず、蒸気がセルの壁にまで達してし まう図6(b)。これに対してヘリウムガスの圧力が P<sub>He</sub>=1300Pa と十分高ければ、蒸気波束からの発光強 度分布は非常にシャープであり図7(a)、前面のヘリ



図 6 蒸気波面からの発光の高速度撮影 (a)P<sub>He</sub>=1300Pa, t=0.2-10µs、(b) P<sub>He</sub>=130Pa, t=0.2-10µs



図7(a) 発光空間分布の2次元観測強度

ウム気相との境界領域では、セルの中心軸に沿って 0.4mmの幅で発光強度が減衰する図7b。P<sub>He</sub>=1300Pa の場合に蒸気波束の進行過程をより詳しく2µs毎に観 測すると、ヘリウム気相と試料ホルダーに挟まれた 蒸気相では密度の振動が見られる図8。これはセル の壁で反射したショック波が蒸気波束と衝突し、波 面が蒸気相に進入したことに因る。蒸気相における



図7(b) 中心軸上における発光強度分布の解析結果

この疎密振動が生じている間でも、蒸気波束の境界 面はヘリウム気相に押されて固定されたままでいる。 これらの観測結果は試料と壁の距離を6mmに設定し て計算機シミュレーションを行った結果と良い一致 を見る図9。シミュレーションの結果では、蒸気波束



図8 蒸気中の波面の伝搬





がヘリウムを押し退けて進行するのに伴い発生する ショック波がヘリウム気相中を伝搬し、壁で反射し て蒸気波束と再び衝突すると、蒸気相とヘリウム気 相双方の密度が上昇し、混合ガス相の幅は狭くなる。 それと同時に蒸気波束の進行が停止し、その後若干 押し戻される様子が良く再現されている。ショック 波の波面が衝突後も蒸気相に移り、試料に向かって 進行する様子は図8の観測結果を良く表している。 次にヘリウムガスの圧力をP<sub>He</sub>=200PaとP<sub>He</sub>=260Paに 変えて、蒸気波束が停止する様子を0.2µs~8µsに渡っ て観測した図10。蒸気波面の位置を時間経過に 沿って表すと、6µsで蒸気波面の進行は停止し、ヘリ ウムガスの圧力に依存して停止位置が決まることが 判明した図11。この結果からクラスター成長の閉 じ込めに必要なヘリウム気相の圧力に対して、試料 と壁との最適距離が求まり、機能性クラスター源の 実用機を設計する上で重要となる。

(4)まとめ

我々はクラスター成長領域を時間的空間的局所領 域に閉じ込めることによって、内部状態の揃ったク



図10 蒸気波束の進行

ラスタービームを生成する機能性クラスター源を制 作し、その性能を次の通り評価した。

- 1)クラスター生成セル内でレーザー照射により噴出した試料素材の蒸気はヘリウム気相中を波束となって進行し、適当なヘリウムガスの圧力の下ではセルの壁まで到達することなく気相中で停止する。
- へリウムガスの圧力が十分高く P<sub>He</sub>=1300Pa では、 蒸気波束とヘリウム気相との境界は 0.4mm の幅で 明確に規定でき、この状態を 15µs 以上に渡って維 持できる。
- 3)蒸気波束とヘリウム気相との境界の時間空間的局 所領域に閉じ込められた混合ガス層では、温度と 気相密度の均一な状態が形成される。クラスター 成長の熱力学的条件が一律に規定できることで、 クラスターサイズやクラスターの電子状態、結晶 構造など内部状態の揃った機能性クラスタービー ムの生成を可能にする。



# 図 1 1 蒸気波面到達距離のヘリウムガ ス圧力依存

4)レーザー出力とヘリウムガスの圧力を調整することで混合ガス層の気相密度と温度が制御できると同時に、混合ガス層が閉じ込められる時間も規定される。クラスター成長の熱力学的条件と閉じ込め時間を調整することにより、任意の大きさのサイズを持つクラスタービームが生成出来る。

以上の結果を踏まえ、機能性クラスタービーム源 の開発はプロセスへの利用を想定した実証段階に 入っている。今後、サイズの揃ったクラスタービーム の取り出し試験、及び結晶基板上への蒸着によるク ラスターの長距離秩序形成の観測試験を進める予定 である。

# 3.機能性クラスタープロセス技術の展望 (1)太陽光発電

エネルギーの規制緩和に伴いエネルギー技術の自 由化が進む中で、競争原理に打ち勝ち長期的環境保 全を図る発電技術として、太陽光発電の意義は大き い。現在開発が進められている薄膜太陽電池では、高 効率化と高安定化を目指した技術開発と廉価生産性 を図るための高速化・大面積生産技術開発が進めら れている。開発が進められている薄膜太陽電池の製 造過程では、その気相中に多量の微細粒子が発生し、 それが薄膜の効率と安定性の低下を招いている。高 速化・大面積化の技術開発では、本質的に微細粒子の 発生は益々助長され、薄膜生成の廉価生産プロセス では微細粒子の制御が重要な鍵を握る。開発を進め る機能性クラスタープロセス技術では粒径の揃った 微細粒子を含むシリコン系ビーム(SiH<sub>2</sub>, (SiH<sub>2</sub>)<sub>N</sub>)の生成 を可能にする。これを利用して、薄膜の均一成長を促 し効率が高く耐光損傷性に優れた薄膜太陽電池の製 造が可能になる。成膜過程において微細粒子の生成 が本質的であれば、微細粒子を含む粒子ビームの高 品質化を図ることで均一な薄膜が生成出来る技術が 重要であり、今後廉価生産性を目指した薄膜太陽電 池の製造技術開発を進める上でも、高品質な微細粒 子ビーム技術の意義は大きい。

## (2)磁気記録メディア

磁気記録メディアの高密度化の技術開発は近年急 速な勢いで進み、1996年に5Gb/in<sup>2</sup>のものが現在では 40Gb/in<sup>2</sup>の研究開発が進められ、米国では100Gb/in<sup>2</sup> を2005年までに達成しようとしている。この高密度 化に伴い、磁性粒子の粒径も10nm程度にまで細かく なり、ナノレベルの制御が要求されている。しかし現 在の薄膜生成技術では粒径分布が均一でないため、 磁気記録メディアを室温で利用する場合その熱的安 定性に欠け、10年間記録を維持することが困難に なっている(Mr<sub>10years after</sub>/Mr<sub>1sec after</sub> < 1.0)。この理由から、 40Gb/in<sup>2</sup>以上の高密度化は原理的に難しいとされて いる。開発を進める機能性クラスタープロセス技術 では、均一な粒径分布(σ=1.01目標値)を持ち、結 晶構造の揃った10nm以下の磁性粒子を生成可能に する。従って、大きさの等しい磁気双極子を持つ磁 性粒子がそれぞれ独立に結晶軸を揃えて基板上に配 列することで高密度化を図る「patterned media」を 可能にする。これにより、高密度で熱的に安定な (Mr<sub>10vears after</sub>/M<sub>r1sec after</sub> = 1.0)磁気記録を可能にし、磁気 記録メディアの開発における技術革新が期待出来る。

#### 研究課題

NSS 基礎基盤研究: クラスター粒子の太陽電池用材料の解析評価 科振費緊急受託研究: 機能的ナノ構造ビーム源に関する緊急研究

#### 参考文献

Y. Iwata, M. Han, S. Kiyama, A. Fukuda, M. Muto, T. Sawada, T. Takiya and A. Komura: *Appl. Phys. Lett.*, to be submitted.
M. Han, S. Kiyama, M. Muto, A. Fukuda, T. Sawada and Y. Iwata: *Nucl. Inst. Methods Phys. Res.*, **B153** pp302-308 (1999).